

## 共同利用型共同研究の対象となる分析機器・設備一覧

分析機器・設備名		規格	歴博での分析例
AMS- <sup>14</sup> C 法支援機器		下記参照	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<sup>14</sup>C 年代測定試料の調製</li> <li>・炭素・窒素安定同位体分析試料の調製</li> <li>・酸素安定同位体分析試料の調製</li> </ul>
内訳	自動 AAA 処理装置	光信理化学製作所 K-RI-C K-RS-C	
	グラファイト精製装置	光信理化学製作所 KS-MK-5 K-R0-L K-RS-EL	
	元素分析計	Thermo 社 Flash EA 1112	
マルチコレクタ ICP 質量分析計 (MC-ICP-MS)		Thermo Fisher Scientific 社 NEPTUNE PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛同位体比の測定 (青銅製品などの産地推定分析等)</li> <li>・ストロンチウム同位体比の測定 (人骨による生育地推定分析等)</li> </ul>
X 線分析顕微鏡		HORIBA (堀場) 社 XGT-5200SL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元素分析 (錦絵色材の分析等)</li> <li>・元素マッピング解析</li> </ul>
蛍光 X 線分析装置 (XRF)		JEOL (日本電子) 社 JSX-3201M	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元素分析 (漆の顔料分析, 金属製品の化学組成分析, 製鉄工程の判定分析等)</li> </ul>
電子線微小部分分析装置 (EPMA)		JEOL (日本電子) 社 JXA-8200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・微小部の観察と元素分析 (金属製品の材質分析等)</li> </ul>
特性 X 線検出器付 低真空電子顕微鏡 (SEM-EDX)		JEOL (日本電子) 社 JSM-6010LA	<ul style="list-style-type: none"> <li>・微小部の観察 (遺跡出土種実同定, 土器の種実圧痕の分析, 金属製品の観察等)</li> <li>・微小部の元素分析</li> </ul>
高温用赤外線サーモグラフィ		JENOPTIK 社 VarioTHERM basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炎の逐次温度測定 (鍛冶技術の数値的分析)</li> <li>・高温時の加工品の温度測定</li> </ul>
赤外線カメラシステム		下記参照	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木簡の文字判別</li> <li>・漆紙文書の文字判別</li> </ul>
内訳	InGaAs カメラ	浜松ホトニクス社 C10633	
	カメラコントローラー	浜松ホトニクス社 C2741-62	